

08

Одиночный нитевидный кристалл теллура как элемент сенсора NO₂: структура и экспресс-демонстрация чувствительности

© М.Р. Рабаданов¹, В.В. Кривецкий², А.М. Исмаилов¹, М.А. Умаканов¹, М.Х. Рабаданов¹

¹ Дагестанский государственный университет, Махачкала, Россия

² Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

E-mail: egdada@mail.ru

Поступило в Редакцию 15 августа 2025 г.

В окончательной редакции 2 сентября 2025 г.

Принято к публикации 3 сентября 2025 г.

Исследованы нитевидные кристаллы (НК) теллура (сплошные и полые) с воспроизводимой морфологией и геометрией, полученные методом испарения теллура в среде водорода. Показана возможность прямой интеграции одиночного НК Тe в микроструктуру газового сенсора и проведена экспресс-оценка его отклика на NO₂ при комнатной температуре. Для НК Тe разного диаметра (28 и 60 μm) зафиксирован сенсорный отклик: при концентрации 5 ppm чувствительность достигает $S \approx 10\%$; минимальный зарегистрированный порог составляет 0.3 ppm (для НК диаметром 28 μm). Полученные результаты подтверждают перспективность применения одиночных НК Тe в миниатюрных газоанализаторах с низким энергопотреблением, причем полые НК Тe представляются особенно перспективными благодаря увеличенному отношению поверхности к объему.

Ключевые слова: нитевидные кристаллы теллура, газовые сенсоры, закись азота, сенсорный отклик.

DOI: 10.61011/PJTF.2026.02.62063.20474

В последние годы растет интерес к созданию высокочувствительных, селективных и энергоэффективных газовых сенсоров (датчиков), способных работать при комнатной температуре, что важно для портативного экологического мониторинга, производственного контроля и неинвазивной медицинской диагностики [1,2]. Традиционные сенсоры на основе оксидов (ZnO, SnO₂, WO₃ и др.) для достижения приемлемой кинетики реакций требуют нагрева до температур 200–400 °C [3]. Это не только приводит к высокому энергопотреблению, но и вызывает проблемы с долговременной стабильностью из-за термической деградации и роста зерен в чувствительном слое. Теллур, являющийся полуметаллом-полупроводником *p*-типа с узкой запрещенной зоной $\sim 0.35\text{ eV}$, оказался одним из немногих материалов, позволяющих детектировать широкий спектр токсичных газов (NO₂, NH₃, H₂S, Cl₂, CO и др.) без нагрева сенсорного элемента [4–14]. Это открывает путь к созданию портативных, носимых и автономных сенсорных систем с ультразвуковым энергопотреблением, способных работать от миниатюрных источников питания в течение длительного времени [15].

Ранние работы были посвящены пленкам теллура, у которых при комнатной температуре фиксировались устойчивые изменения сопротивления под воздействием окислительных (NO₂, Cl₂) и восстановительных (NH₃, H₂S) газов [4–6]. Дальнейшие исследования показали, что переход от сплошных пленок теллура к низкоразмерным структурам (нитевидные кристаллы (НК) и нанотрубки [7–14], наночастицы [16], 2D-теллур (теллурен) [17]) существенно увеличивает удельную поверхность материала, усиливает влияние поверхностных

зарядовых состояний и тем самым повышает чувствительность сенсоров, снижая их порог обнаружения.

Несмотря на широкую апробацию традиционных методов синтеза НК Тe [18], включая гидротермальный и сольватермальный синтез, физическое осаждение из газовой фазы, электроосаждение, а также методы растворения и рекристаллизации, их возможности для обеспечения прецизионного контроля морфологии и высокой воспроизводимости во многом уже исчерпаны. Данное ограничение стимулирует поиск и развитие альтернативных технологических подходов, способных обеспечивать стабильный синтез НК Тe с точно заданными структурными и размерными характеристиками. Недостаточный контроль над морфологией и воспроизводимостью, присущий традиционным методам синтеза, является ключевым фактором, ограничивающим глубокое и систематическое изучение эксплуатационных характеристик газовых сенсоров на основе НК Тe. В связи с этим основной целью настоящей работы является разработка нового метода синтеза — переноса паров теллура в среде водорода. Метод позволяет получать массив НК Тe с заданной и воспроизводимой морфологией. В работе представлены результаты прямого интегрирования одиночного НК Тe в измерительную микроструктуру и проведена экспресс-оценка его газочувствительных свойств при комнатной температуре.

В работе использовался теллур высокой чистоты марки 6N (99.9999 %) (5N Plus, Канада). НК Тe были получены методом термовакуумного испарения теллура в среде водорода [19]. Методика получения НК Тe предусматривает управление процессом кристаллизации через контроль температуры зоны тигля T_2 и

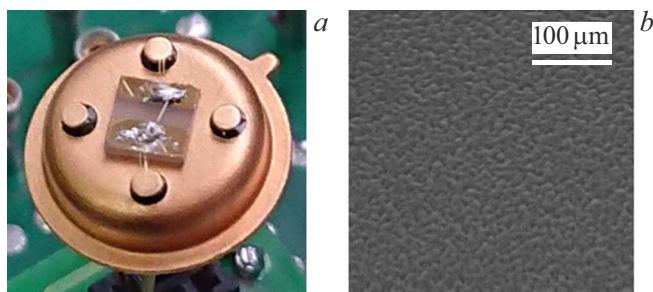


Рис. 1. *a* — фотография экспериментального образца сенсорной структуры; *b* — СЭМ-изображение боковой поверхности НК Te.

подложки T_1 , температурного перепада между этими зонами $\Delta T = T_2 - T_1$ и исходного давления водорода $P(H_2)$ в реакторе. Морфология НК Te, а также их геометрические размеры исследовались на сканирующем электронном микроскопе (СЭМ) Leo 1450 (Carl Zeiss, Германия) в режиме вторичных электронов. Кристаллическую структуру изучали на рентгеновском дифрактометре Empyrean Series 2 (PANalytical, Нидерланды) с использованием $CuK\alpha$ -излучения ($\lambda = 0.15406 \text{ nm}$). В качестве подложки использовалась микросетка (материал — никром, диаметр нити $25 \mu\text{m}$, размер ячейки $25 \times 25 \mu\text{m}$). Манипуляции и перенос НК диаметром $10-100 \mu\text{m}$ выполнялись с помощью микропроволоки в поле зрения оптического микроскопа.

Для сенсорных измерений из массива были отобраны два НК Te, полученных при следующих условиях: $T_2 = 600^\circ\text{C}$, $T_1 = 430^\circ\text{C}$, $\Delta T = 170^\circ\text{C}$, $P(H_2) = 0.8 \text{ atm}$. Обозначения: НК Te диаметром $28 \mu\text{m}$ — образец № 1, НК Te диаметром $60 \mu\text{m}$ — образец № 2. На рис. 1, *a* показана фотография собранного для исследования образца газового сенсора, основой которого служит корпус КЮЯЛ.431433.018-03 (АО „Завод „Марс“, Россия). В центре корпуса закреплена квадратная подложка из поликорда ($3 \times 3 \times 0.5 \text{ mm}$), на поверхности которой методом магнетронного распыления сформированы две параллельные полоски золота, служащие контактными площадками. Между площадками расположен одиночный нитевидный кристалл теллура (чувствительный элемент), прикрепленный к золотым дорожкам с помощью низкотемпературного сплава типа Розе, что исключает термическое повреждение (окисление) кристалла Te. Для подключения образца к измерительной системе каждая золотая площадка соединена с соответствующим выводом корпуса двумя параллельными золотыми проволоками диаметром $\sim 25 \mu\text{m}$, приваренными методом ультразвуковой микросварки.

Относительный сенсорный отклик определялся выражением $S = (R_0 - R_g)/R_0$, где R_0 — базовое сопротивление в воздухе, R_g — минимальное сопротивление во время воздействия газа (NO_2). В качестве времени отклика и времени восстановления брались длительности, за которые электрическое сопротивление сенсора достигало

90 % от величины R_0 или R_g соответственно. Концентрация детектируемого газа (в ppm) снижалась ступенчато: $5 \rightarrow 2.5 \rightarrow 1.25 \rightarrow 0.7 \rightarrow 0.3 \rightarrow 0$. Каждый уровень задавался серией коротких импульсов газ—воздух, представлявших собой продувку газовой камеры потоком сухого воздуха 100 ml/min с примесью газа в заданной концентрации в течение 900 s , затем следовал этап продувки чистым сухим воздухом той же длительности. Потоки для смешения воздуха и газа задавались с помощью высокоточных массовых регуляторов расхода Bronkhorst (Нидерланды). В качестве источника чистого воздуха использовался генератор чистого воздуха ГЧВ 1.2 (ООО „Химэлектроника“, Россия). В качестве источника газа использовалась поверочная газовая смесь в баллоне (ООО „Мониторинг“, Россия).

Метод роста позволяет в широких пределах регулировать пересыщение в системе путем изменения управляемых технологических параметров (T_1 , T_2 , ΔT , $P(H_2)$) и тем самым выбирать оптимальные режимы синтеза НК Te различного размера и морфологии (сплошных/полых). На рис. 2 представлены характерные морфологии нитевидных кристаллов теллура: сплошной НК (*a*) и полый НК в форме микротрубки (*b*). В массиве НК всегда наблюдается разброс размеров, главным образом по диаметру, что связано с локальной неоднородностью подложки. Четкой границы перехода от сплошных к полым НК по технологическим параметрам не выявлено. Установлены лишь режимы, при которых преобладают структуры разных морфологических типов. Характерные размеры НК Te: диаметр $50 \text{ nm} - 100 \mu\text{m}$, длина до 1.5 cm , скорость роста $200 \mu\text{m}/\text{min}$ ($\sim 1.2 \text{ cm}/\text{h}$), толщина стени микротрубки $1-5 \mu\text{m}$. На рис. 1, *b* виден развитый микрорельеф поверхности НК Te. Варьируя приведенные выше параметры, его можно целенаправленно модифицировать с целью улучшения сенсорных характеристик.

Для рентгенофазового анализа был сформирован образец из массива параллельно ориентированных НК Te ($d = 10-80 \mu\text{m}$, $L \approx 8 \text{ mm}$) на стеклянной подложке; пучок направляли вдоль оси кристаллов, вращение образца не применялось. В такой геометрии регистрируются рефлексы (100), (200), (300), а также отражения плоскости (110) и (220) из-за произвольного поворота НК вокруг оси *c* (рис. 3). Небольшая полуширина главного

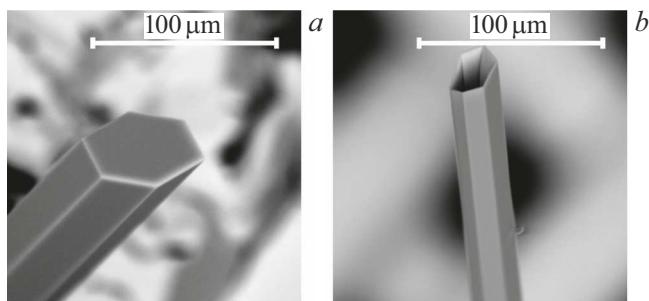


Рис. 2. Морфология нитевидных кристаллов теллура. *a* — сплошной НК; *b* — полый НК (микротрубка).

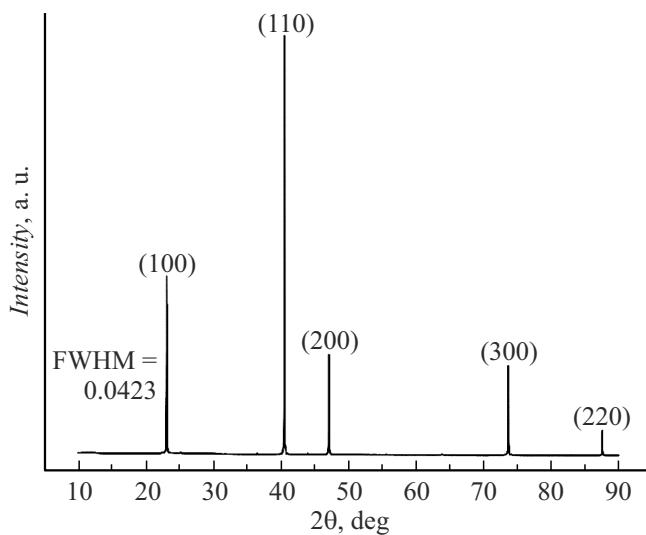


Рис. 3. Рентгенограмма массива НК Тe.

пика (100) $\text{FWHM} \approx 0.042^\circ$ (2θ) указывает на высокое кристаллическое качество, превосходящее качество монокристаллов и эпитаксиальных пленок Тe [20].

Динамика сопротивления двух сенсорных образцов из одиночных НК Тe разного диаметра при напуске детектируемого газа демонстрирует ожидаемый характерный отклик (рис. 4, a). Исходное сопротивление R_0 образца № 1 (НК меньшего диаметра) составляет $\sim 10.3 \text{ k}\Omega$, тогда как у образца № 2 (НК большего диаметра) $\sim 4.5 \text{ k}\Omega$, что подтверждает обратную зависимость R_0 от диаметра НК. При каждом импульсном введении NO_2 сопротивление падает, поскольку адсорбированная молекула NO_2 захватывает электрон валентной зоны теллура и концентрация дырок возрастает. Пики отклика на одном и том же уровне концентрации NO_2 повторяются с одинаковой формой и высотой, что указ-

зывает на высокую воспроизводимость адсорбционно-десорбционных процессов. В начале опыта наблюдается небольшое снижение R_0 , вероятно связанное с термостабилизацией, а при переходе к низким концентрациям фиксируется умеренный рост базовой линии, что можно отнести к постепенной пассивации поверхности или накоплению кислородсодержащих радикалов. Несмотря на различие абсолютных R_0 , относительная чувствительность $S = \Delta R/R_0$ у обоих образцов сильно не отличается (рис. 4, b). В области низких концентраций 0.3–0.7 ppm отклик образца № 2 немного выше. В интервале 1.25–2.5 ppm кривые фактически сходятся, а при высоких концентрациях ~ 5 ppm преимущественно переходит к образцу № 1. Обе зависимости близки к квазилинейным, однако в пределах 1.25–5 ppm у образца № 2 проявляется более выраженное „насыщение“, тогда как у тонкого образца сохраняется более крутой прирост. Небольшое преимущество толстых НК при самых малых концентрациях может быть связано с различиями в дефектности, контактах или статистике активных адсорбционных центров — это требует индивидуальной проверки.

Времена отклика и восстановления сенсоров приведены в таблице.

Сенсоры на основе одиночных НК Тe демонстрируют относительно быстрый, стабильный и обратимый отклик для устройств, работающих без дополнительного подогрева, так как времена отклика для обоих образцов для большинства концентраций не превышают 10 min. При этом небольшая относительная погрешность величины сигнала свидетельствует о его стабильности, а времена восстановления, укладывающиеся в интервал 15 min, — об обратимости.

Таким образом, разработана воспроизводимая технология синтеза НК Тe с управляемыми морфологией, размерами,nanoструктурой поверхности. Дальнейшие исследования в этой области будут направлены на

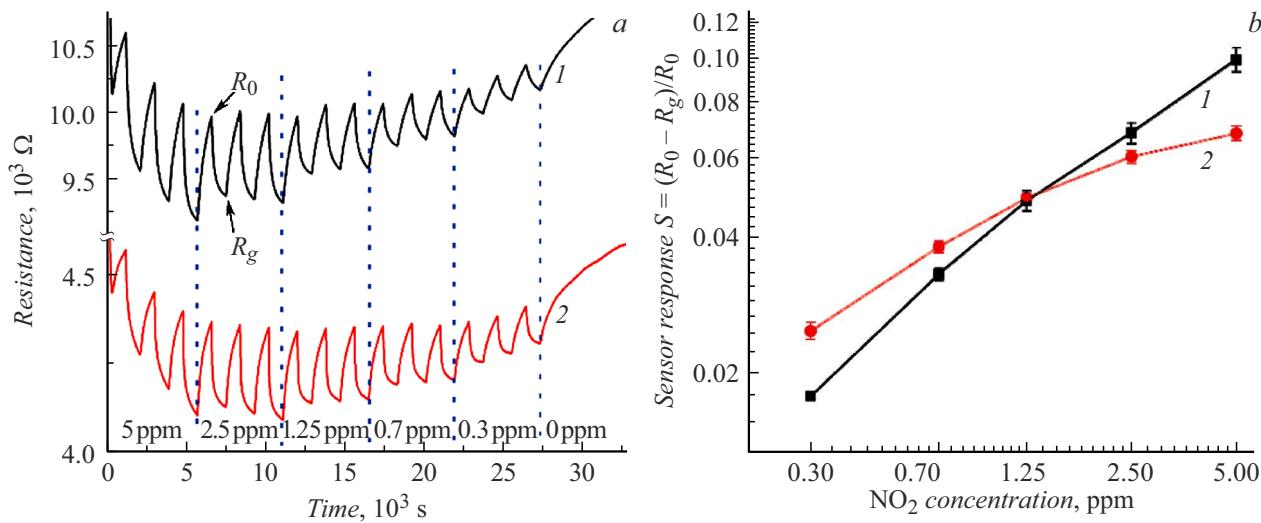


Рис. 4. а — временные зависимости сопротивления газовых сенсоров; б — зависимость относительного сенсорного отклика S от концентрации NO_2 для газовых сенсоров. Номера кривых соответствуют номерам образцов.

Времена отклика и восстановления сенсоров на основе полых НК Тe

Концентрация NO_2 , ppm	Образец № 1		Образец № 2	
	Время отклика, с	Время восстановления, с	Время отклика, с	Время восстановления, с
5	521	683	576	613
2.5	493	756	402	702
1.25	548	779	338	729
0.7	612	791	385	742
0.3	646	825	371	783

совершенствование технологии синтеза НК Тe с целью преодоления ключевых ограничений материала как сенсора, а именно на сокращение длительного времени восстановления сигнала; повышение стабильности характеристик в условиях переменной влажности; повышение селективности (различение газов внутри одного класса). Наиболее перспективным подходом представляется использование полых НК Тe (микротрубок) в качестве сенсорного элемента (рис. 2, b). Преимущество микротрубок Тe заключается в увеличенном отношении поверхность/объем по сравнению со сплошными НК, что обеспечивает более высокое удельное значение поверхности для адсорбции/десорбции детектируемого газа.

Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

Список литературы

- [1] L.-X. Ou, M.-Y. Liu, L.-Y. Zhu, D.W. Zhang, H.-L. Lu, Nano-Micro Lett., **14**, 206 (2022). DOI: 10.1007/s40820-022-00956-9
- [2] B. Zong, S. Wu, Y. Yang, Q. Li, T. Tao, S. Mao, Nano-Micro Lett., **17**, 54 (2025). DOI: 10.1007/s40820-024-01543-w
- [3] A. Dey, Mater. Sci. Eng. B, **229**, 206 (2018). DOI: 10.1016/j.mseb.2017.12.036
- [4] S. Sen, K.P. Muthe, N. Joshi, S.C. Gadkari, S.K. Gupta, Jagannath, M. Roy, S.K. Deshpande, J.V. Yakhmi, Sensors Actuators B, **98** (2-3), 154 (2004). DOI: 10.1016/j.snb.2003.10.004
- [5] D. Tsuiyuanu, A. Tsuiyuanu, H.D. Liess, I. Eisele, Thin Solid Films, **485** (1-2), 252 (2005). DOI: 10.1016/j.tsf.2005.03.045
- [6] T. Siciliano, M. Di Giulio, M. Tepore, E. Filippo, G. Micocci, A. Tepore, Sensors Actuators B, **135** (1), 250 (2008). DOI: 10.1016/j.snb.2008.08.018
- [7] D. Tsuiyuanu, Beilstein J. Nanotechnol., **11**, 1010 (2020). DOI: 10.3762/bjnano.11.85
- [8] S. Sen, M. Sharma, V. Kumar, K.P. Muthe, P.V. Satyam, U.M. Bhatta, M. Roy, N.K. Gaur, S.K. Gupta, J.V. Yakhmi, Talanta, **77** (5), 1567 (2009). DOI: 10.1016/j.talanta.2008.09.055
- [9] T. Siciliano, E. Filippo, A. Genga, G. Micocci, M. Siciliano, A. Tepore, Sensors Actuators B, **142**, 185 (2009). DOI: 10.1016/j.snb.2009.07.050
- [10] Z. Wang, L. Wang, J. Huang, H. Wang, L. Pan, X. Wei, J. Mater. Chem., **20** (12), 2457 (2010). DOI: 10.1039/b924462j
- [11] Y.C. Her, S.L. Huang, Nanotechnology, **24** (21), 215603 (2013). DOI: 10.1088/0957-4484/24/21/215603
- [12] H. So, J. Yoo, K. Ryu, M.H. Yang, K.J. Lee, Ceram. Int., **45** (6), 7226 (2019). DOI: 10.1016/j.ceramint.2019.01.003
- [13] T. Siciliano, A. Genga, G. Micocci, M. Siciliano, M. Tepore, A. Tepore, Sensors Actuators B, **201**, 138 (2014). DOI: 10.1016/j.snb.2014.04.098
- [14] L. Guan, S. Wang, W. Gu, J. Zhuang, H. Jin, W. Zhang, T. Zhang, J. Wang, Sensors Actuators B, **196**, 321 (2014). DOI: 10.1016/j.snb.2014.02.014
- [15] L. Wang, X. Yao, Y. Zhang, G. Luo, B. Wang, X. Yu, Next Mater., **2**, 100092 (2024). DOI: 10.1016/j.nxmate.2023.100092
- [16] S. Yoon, T. Kim, S.-S. Chee, Y. Kim, H. Jung, Appl. Surf. Sci., **684**, 161800 (2025). DOI: 10.1016/j.apsusc.2024.161800
- [17] Y. Je, S.S. Chee, Electron. Mater. Lett., **21** (1), 94 (2025). DOI: 10.1007/s13391-024-00520-0
- [18] H. Zhu, L. Fan, K. Wang, H. Liu, J. Zhang, S. Yan, Nanomaterials, **13**, 2057 (2023). DOI: 10.3390/nano13142057
- [19] А.М. Исмаилов, И.М. Шапиев, М.Х. Рабаданов, И.Ш. Алиев, Письма в ЖТФ, **41** (2), 64 (2015). [A.M. Ismailov, I.M. Shapiev, M.Kh. Rabadanov, I.Sh. Aliev, Tech. Phys. Lett., **41** (1), 83 (2015). DOI: 10.1134/S1063785015010265].
- [20] М.Р. Рабаданов, А.А. Степуренко, А.Э. Гумметов, А.М. Исмаилов, ФТП, **55** (6), 493 (2021). DOI: 10.21883/FTP.2021.06.50913.9631 [M.R. Rabadanov, A.A. Stepurenko, A.E. Gummetov, A.M. Ismailov, Semiconductors, **55**, 551 (2021). DOI: 10.1134/S1063782621060129].